

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年9月4日(04.09.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/182587 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/66 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2025/004750

(22) 国際出願日: 2025年2月13日(13.02.2025)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2024-026789 2024年2月26日(26.02.2024) JP

(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 (JP).

(72) 発明者: 田代 晃一朗 (**TASHIRO, Koichiro**); 〒4078511 山梨県韮崎市藤井町北下条2381-1 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 (JP). 中山 博之(**NAKAYAMA, Hiroyuki**); 〒4078511 山梨県韮崎市藤井町北下条2381-1 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社内 (JP).

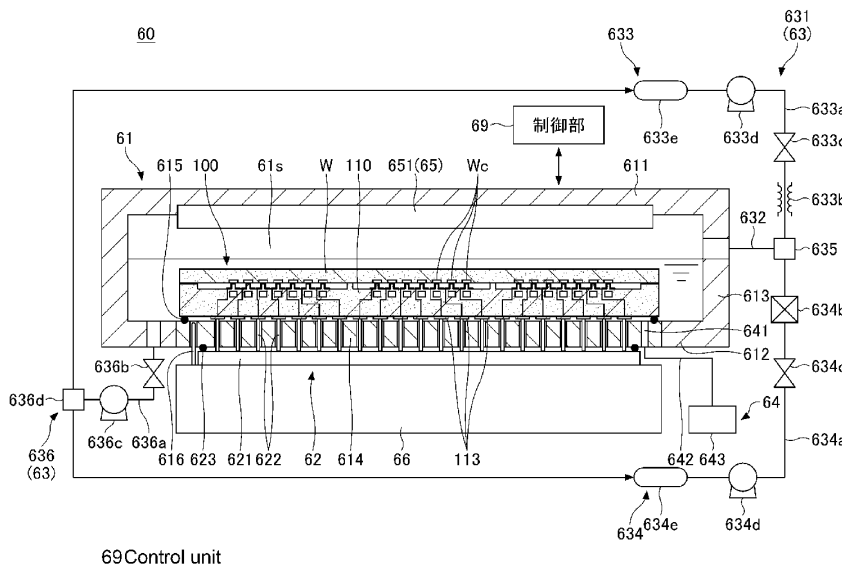
(74) 代理人: 弁理士法人 I T O H (**ITOH PATENT ATTORNEY CORPORATION**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル16階 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,

(54) Title: INSPECTION DEVICE AND INSPECTION METHOD

(54) 発明の名称: 検査装置、および検査方法

[図5]



(57) Abstract: This inspection device inspects a shell structure in which a section where electrical conduction is established between a conductive portion of a substrate and a jig contact portion is sealed. The inspection device comprises: a housing; a probe that contacts an electrode of the jig in electrical conduction with the contact portion, inside the housing; a temperature adjustment medium circulation unit that supplies and discharges a temperature adjustment medium into and out of the housing; and a control unit. The control unit controls: (A) a step for placing the shell structure with the

[続葉有]

BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

probe and the electrode being in contact with each other; (B) a step for adjusting the temperature of the shell structure by supplying the temperature adjustment medium from the temperature adjustment medium circulation unit and immersing at least a portion of the shell structure in the temperature adjustment medium; and (C) a step for inspecting the substrate of the shell structure via the probe.

(57) 要約: 検査装置は、基板の導通部と治具のコンタクト部とを導通させた部分を密閉したシェル構造体を検査する。検査装置は、筐体と、筐体の内部において、コンタクト部に導通した治具の電極に接触するプローブと、筐体の内部に温度調整媒体を供給および排出させる温度調整媒体流通部と、制御部と、を含む。制御部は、(A) プローブと電極とを接触させた状態でシェル構造体を載置する工程と、(B) 温度調整媒体流通部から温度調整媒体を供給し、シェル構造体の少なくとも一部を温度調整媒体に浸すことでシェル構造体の温度を調整する工程と、(C) プローブを介してシェル構造体の基板を検査する工程と、を制御する。